

## 会 告 原 稿

### 第 26 回 分 析 電 子 顕 微 鏡 討 論 会

「分析電子顕微鏡の基礎から最先端技法まで」

**主催** 日本顕微鏡学会

**協賛** 日本分析化学会ほか

**期日** 8月31日(火) 10時～9月1日(水) 17時まで

**会場** 幕張メッセ

**内容** 今回は EDS、EELS およびホログラフィや球面収差補正に関する基礎(チュートリアル)とともに、分析技術の進展や3D技法の最新情報を紹介しますとともに、試料作製法について講演が行われます。また特別講師を招いての特別講演も催されます。一般からの口頭発表も募集していますので、奮ってご参加ください。

**申込締切** 8月24日(火), 定員200名になりしだい締め切り。

**参加費(予稿集含む)** 会員及び協賛学会員 6,000円, 非会員 7,000円, 学生 無料

**プログラム・申込方法** 詳細については、分析電子顕微鏡討論会のホームページ (<http://tem.zaiko.kyushu-u.ac.jp/bunseki/>) をご参照下さい。

**問合先(兼連絡先)** 〒819-80395 福岡市西区元岡 744

九州大学大学院工学研究院材料工学部門

金子賢治 [電話・FAX: 092-802-2959, E-mail: bunseki@tem.zaiko.kyushu-u.ac.jp]